文章编号:0253-2239(2002)02-0196-05

二维限制多模干涉器自镜像效应分析*

马慧莲 江晓清 王明华

(浙江大学信电系,杭州 310027)

摘要: 采用导模传输分析法对二维限制多模干涉器的自镜像效应进行分析,并用三维全矢量光束传输法对其分析结果作了进一步的验证。分析表明,一维限制多模干涉器的自镜像效应可以完全拓展到二维上。 关键词: 二维限制;多模干涉;自镜像效应;导模传输分析法;三维全矢量光束传输法 中图分类号:TN25 文献标识码:A

1 引 言

当前,集成光学的研究与应用基本上局限于波 导平行于衬底的单一平面,因此,相邻波导的最小间 距限制了集成光学芯片上的信道数。通常,这个最 小间距是由相邻波导间的耦合情况或输入、输出波 导与光纤相连时由光纤的几何尺寸所决定。为获得 较小尺寸的器件,通常采用强限制的波导结构。然 而,其较小的模场直径降低了与标准通信光纤的耦 合效率。近几年提出的向第三维空间发展的集成光 学可以有效地解决这对矛盾¹²。

基于自镜像效应(SIE)的多模干涉(MMI)器由 于其具有结构紧凑、插入损耗低、频带较宽、制作工 艺简单和容差性好等优点,近年来广泛应用于光功 分器、TE/TM模式分离器、马赫-曾德尔光开关、光 分波/合波器、环形激光器、可调多波长光源发射 器^{3~7]}等,可见,多模干涉器几乎参与到了每一个复 杂的器件或小系统中,它是集成光学中相当重要的 一个组成部分。

然而以往的多模干涉器的多模波导区只在一个 方向上(平行于衬底)支持多模,而在另一个方向(垂 直于衬底方向)只允许单模传输,故对其分析和应用 在器件的横截面上都局限于一维自镜像效应,当多 模干涉区横截面两个方向尺寸相当时,也就是在垂 直于衬底方向也支持多模传输时(如目前应用较多 的全 SiO₂ 和有机聚合物材料),必须考虑其二维自 镜像效应,而且也可以利用其二维自镜像效应将原

E-mail :hzmahl@163.net 收稿日期 2001-06-22;收到修改稿日期 2001-09-07 来的器件平面集成向空间集成拓展 ,以获得更高的 集成度。

在一维自镜像效应的分析中,人们研究了许多 数值和解析方法,其中导模传输分析法是一种快速、 简单、有效的近似方法³¹。

本文采用导模传输分析法对二维限制多模干涉 器的自镜像效应进行分析,分析表明,一维限制多模 干涉器的自镜像效应可以完全拓展到二维上,并用 三维全矢量光束传输法⁸¹对其分析结果作了进一步 的验证。

2 三维矩形波导的 Marcatili 分析^[9]

本文分析的二维限制多模干涉器的基本波导结 构如图 1(a)所示,它是由周围被较小折射率 n₂的 限制媒质包裹着的折射率 n1 的波导区域构成。在 限制媒质中的折射率不必在所有区域中都一样。假 设模是良好被导的 也就是远离截止 所以场在区域 2、3、4和5呈指数衰减,大部分功率限制在区域1, 在图1(b)的划斜线角形区域中场的幅度小到可以 忽略不计。因此 麦克斯韦方程可以通过假设简单 的正弦和指数场分布、并且只沿着区域1的四边匹 配边界条件来解。可以证明波导维持离散数目的导 模分为 E_ω 和 E_ω (μ, μ = 1 2 3, ...)两族 ,其中模数 μ 和 ν 分别对应在 x 和 γ 方向场分布的峰的数目。 $\mathbf{E}_{u\nu}^{x}$ 模的横向场分量是 E_x 和 H_y 而 $E_{\mu\nu}^y$ 横向场分量是 E_y 和 H_x 。模的形状由它在指数区域内的消光系数 η_2 、 ξ_3, η_4 和 ξ_5 以及在区域 1 中的传播常数 k_x 和 k_y 表 征。设 k_{x_a} 和 k_{x_a} (a = 1 2 3 A 5)是在各个媒质中沿 x 和y 方向的横向传播常数。匹配边界条件需假设

$$k_{x1} = k_{x2} = k_{x4} = k_x , \qquad (1)$$

^{*}浙江省自然科学基金(600028),高等学校骨干教师、浙 江省自然科学基金(601130)资助课题。

197

以及





Fig.1 (a) Schematic diagram of three-dimensional waveguide. n₁ > n₂. (b) Cross-section of three-dimensional waveguide 还可以证明区域 1 中的纵向传播常数 β 满足

 $\beta = (k_1^2 - k_x^2 - k_y^2)^{1/2}$, (3) 其中 $k_1 = kn_1 = (2\pi/\lambda_0)n_1$, λ_0 为真空中的波长。在 集成光路的通常情形中, n_1 仅稍大于其他的 $n_x(\nu)$ 次 模的有效折射率),因此 k_x 和 $k_y \ll k_1$ 利用二项式展 开(3)式可近似为

$$\beta \approx k_1 - \frac{1}{2} \frac{k_x^2}{k_1} - \frac{1}{2} \frac{k_y^2}{k_1} , \qquad (4)$$

由区域1的边界上匹配场分量得出超越方程

$$k_x W_x = \mu \pi - \arctan \left[k_x \left(k_1^2 - k_3^2 - k_x^2 \right)^{-1/2} \right] - \arctan \left[k_x \left(k_1^2 - k_3^2 - k_x^2 \right)^{-1/2} \right], \quad (5)$$

$$k_{y}W_{y} = \nu\pi - \arctan\left[\frac{n_{2}^{2}}{n_{1}^{2}}k_{y}\left(k_{1}^{2} - k_{2}^{2} - k_{y}^{2}\right)^{-1/2}\right] - \arctan\left[\frac{n_{4}^{2}}{n_{1}^{2}}k_{y}\left(k_{1}^{2} - k_{4}^{2} - k_{y}^{2}\right)^{-1/2}\right].$$
 (6)

然而对于良好限制的模可以假设大部分光功率是在 区域1中。因此

$$\frac{k_x^2}{k_1^2 - k_3^2} \ll 1 , \qquad \frac{k_x^2}{k_1^2 - k_5^2} \ll 1 , \\ \frac{k_y^2}{k_1^2 - k_2^2} \ll 1 , \qquad \frac{k_y^2}{k_1^2 - k_4^2} \ll 1 . \end{cases}$$
(7)

使用(7)式的假设,通过把(5)式中的反正切函数按 幂级数展开,只保留前两项,可以得到 k_x 和 k_y 的近 似解,

$$k_x = \frac{u\pi}{W_{xeff}}$$
, $k_y = \frac{\nu\pi}{W_{yeff}}$, (8)

其中 W_{xeff} 和 W_{yeff} 分别是 x 和 y 方向的有效宽度 ,可

近似如下:

$$W_{xeff} \approx W_x + \frac{1}{\pi} \frac{\lambda_0}{2} [(n_1^2 - n_3^2)^{-1/2} + (n_1^2 - n + 2_5)^{-1/2}], \qquad (9)$$

$$W_{\text{yeff}} \approx W_{y} + \frac{1}{\pi} \frac{\lambda_{0}}{2} \left[\frac{n_{2}^{2}}{n_{1}^{2}} \left(n_{1}^{2} - n_{2}^{2} \right)^{1/2} + \frac{n_{4}^{2}}{\pi^{2}} \left(n_{1}^{2} - n_{4}^{2} \right)^{1/2} \right].$$
(10)

以上分析的是 $E_{\mu\nu}^{y}$ 模 对于 $E_{\mu\nu}^{x}$ 模 將 W_{xeff} 表达式和 W_{yeff} 表达式互换即可。

3 二维限制多模干涉器工作原理

多模干涉器的工作原理是基于 Ulrich 发现的多 模波导的自镜像效应,自镜像效应是波导中被激励 起来的模式间的相长性干涉的结果。通过这个效 应,沿波导的传播方向将周期性地产生输入场的一 个或多个像。导模传输分析法由于不考虑辐射模的 影响,而把输入场看成所有导模的线性组合,故该方 法比较简单,在输入场的空间谱窄到不能激励起辐 射模的情况下,这是一种非常有效的近似方法。设 光波从 *z* = 0 处入射到多模波导区,输入场 ∉(*x*,*y*) 可写成所有导模的线性组合,

$$\psi(x,y,0) = \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \varphi_{\mu\nu}(x,y),$$
 (11)

其中 $\varphi_{\mu\nu}(x,y)$ 是 x 方向为 μ 次模、y 方向为 ν 模的场 分布 $R_{\mu\nu}$ 为其场激励系数。在多模波导终断 z = L处的横向场分布为

$$\psi(y, y, L) = \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \varphi_{\mu\nu}(x, y) \exp(j\omega t - j\beta_{\mu\nu}L), \quad (12)$$

其中 $\beta_{\mu\nu}$ 为 $\varphi_{\mu\nu}$ (x ,y)的纵向传播常数。

由(4)式和(8)式得

$$\beta_{\mu\nu} \approx \frac{2\pi n_1}{\lambda} - \frac{\mu^2 \pi}{3L_x} - \frac{\nu^2 \pi}{3L_y} , \qquad (13)$$

其中

$$L_x = \frac{4n_1 W_{xeff}^2}{3\lambda}$$
, $L_y = \frac{4n_1 W_{yeff}^2}{3\lambda}$. (14)

从(12) 武隐去一个模恒等于1的公因子

$$\exp(-j\beta_{11}L + j\omega t)$$
,

并利用(13) 试得

$$\psi(x,y,L) = \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \varphi_{\mu\nu}(x,y) \times$$

$$\exp\left\{\left[j\frac{(\mu+1)(\mu-1)\pi}{3L_x}+j\frac{(\nu+1)(\nu-1)\pi}{3L_y}\right]L\right\}.$$
(15)

令 μ' = μ − 1 ,ν' = ν − 1(μ' ,ν' = 0,1 2 3...)
 则
 (15)式可写成:

$$\psi(x,y,L) = \sum_{\mu'} \sum_{\nu'} c_{\mu'\nu'} \varphi_{\mu'\nu'} \times \exp\left\{ \left[j \frac{(\mu'+2)\nu'\pi}{3L_x} + j \frac{(\nu'+2)\nu'\pi}{3L_y} \right] L \right\}. (16)$$

对照一维限制多模干涉器工作原理³¹,二维限制多 模干涉器工作原理可描述如下:当多模干涉区长度 L满足以下关系时

$$L = \frac{mp_x}{q_x} 3L_x = \frac{np_y}{q_y} 3L_y ,$$
 (17)

x和y方向将分别成 q_x 和 q_y 重像, p_x 和 p_y 分别是和 q_x 、 q_y 互质的整数,m和n分别是x-z和y-z平面的干 涉机理因子,一般干涉原理,m(n) = 1,成对干涉原 理,m(n) = 1/3,对称干涉原理m(n) = 1/4。

4 应用举例和分析比较

设定波导芯层折射率 $n_1 = 1.46$ 波导限制层折 射率 $n_2 = 1.45$,工作波长 $\lambda_0 = 1.55$ μ m ,则输入、输 出单模波导芯区尺寸可取 $6 \ \mu m \times 6 \ \mu m^2$ 。在以下的分 析中 ,输入光场均采用芯径为 $6 \ \mu m$ 的单模光纤基 模 ,并且都是针对 $E_{\mu\nu}^x$ 模。

示例 1 选取 *x-z* 和 *y-z* 平面结构完全对称, 设多 模干涉区芯区尺寸为 48 μ m × 48 μ m ,即 $W_x = W_y =$ W,由(9)式、(10)式和(14)式可知, $L_x = L_y$ 。设输入 光场中心坐标为(-21 3 0),即 *x-z* 和 *y-z* 平面均为 一般输入模式,此时干涉机理因子 m = n = 1,为获 得较小尺寸的器件,一般取 $p_x = p_y = 1$,这样由(17) 式可知,要同时在 *x-z* 和 *y-z* 平面成完整的像,必须令 $q_x = q_y$,此时二维限制自镜像效应在 *x-z* 和 *y-z* 平面 将完全对称。令 $q_x = q_y = 2$,由(14)式、(17)式得, $L \approx 4900 \ \mu$ m。图 2给出了 $z = 4900 \ \mu$ m时的 *x-z* 平面输 出光场分布示意图。

在图 3 中,我们用导模传输分析法进一步分析 了器件附加损耗与多模干涉区长度的关系。结果表 明,二维限制多模干涉器件类似于一维限制多模干 涉器件有较大的工艺制作容差性。

示例 2 :由(17)式不难发现,要同时在 x-z 和 y-z平面成完整的像,多模干涉区芯区尺寸 W_x 和 W_y 的 比值将只能是某些离散的数值,同时 W_x 和 W_y 的取 值也决定了 x-z 和 y-z 平面的成像情况。取 m = n = 4 $p_x = p_y = 1$ $q_x = 4$ $q_y = 2$ 这样由(17)式可知, 要同时在 *x*-*z* 和 *y*-*z* 平面成完整的像,必须令 $W_x = \sqrt{2}W_y$ 。图 4 和图 5 分别给当多模干涉区芯区尺寸为 $48\sqrt{2} \mu m \times 48 \mu m$ 时, *z* = 1225 μm 处的 *x*-*z* 和 *y*-*z* 平面输出光场分布示意图。



Fig. 2 Schematic diagram of output field distribution at $z = 4900 \ \mu m$ under general-fed condition



Fig.3 Excess loss versus the MMI section length with other parameters fixed





光束传输法是模拟光在介质中传播的一种非常 有效的方法,光束传输法从早期的快速傅里叶变换二 维标量光束传输法,发展到三维全矢量光束传输 法⁸¹在模拟精度和运算速度上都有较大改进,故本 文直接采用三维全矢量光束传输法来进一步验证导 模传输分析法在二维限制多模干涉器上的分析精度。

图 6 是直接采用三维全矢量光束传输法模拟了



2期

Fig. 5 Schematic diagram of output field distribution at y-x

plan $z = 1225 \mu m$ under center-fed condition 示例 1 多模干涉器在 $y = 3 \mu m$ 时 x-z 平面的输出光 功率演变情况 ,从图 6 可知 x-z 平面输出光功率的 最大值出现在 4920 μm 附近。



Fig.6 Evolution of output power in x-z plane at y = 3 μm 图 7 是对称输入时 示例 2 多模干涉器 z = 1225 μm 处的输出光场分布情况。



Fig.7 Diagram of output field distribution at $z = 1225 \ \mu m$ under center-fed condition when $W_x = W_y = 48 \sqrt{2} \ \mu m \times 48 \ \mu m$, $z = 1225 \ \mu m$

可见,以往分析一维限制多模干涉器自镜像效 应的导模传输分析法可以在保证其快速、简洁的特 点下,能以较高的分析精度给出自镜像位置,从而简 化二维多模干涉器的设计。分析结果的误差主要来 自(4)式、(9)式和(10)式的近似,完全类似于导模传 输分析法在分析一维限制多模干涉器自镜像效应时 所产生的误差影响,Huang 的文章中以对这种近似 所产生的误差作过较详细的分析 ,并提出了减小误 差的相应补偿措施^{10]}。

总结 本文采用导模传输分析法对二维限制多模干 涉器的自镜像效应进行分析,并用三维全矢量光束 传输法对其分析结果作了进一步的验证。分析表 明,一维限制多模干涉器的自镜像效应可以完全拓 展到二维上,这将大大提高器件的集成度。而且,这 种器件结构也较容易在目前研究较多的全 SiO₂ 或 有机聚合物材料上实现,当输入波导位于多模干涉 区底部时,利用通常的光刻工艺就可实现,至于输出 波导,可采用光纤和 V型槽加以引出,不过值得指 出的是,这种器件的优势在考虑许多器件单片集成 时将有更大的体现。

参考文献

- [1] Garner S M, Lee S S, Chuyanov V et al.. Three-dimensional integrated optics using polymers. IEEE J. Quant. Electron., 1999, QE-35(8):1146~1155
- [2] Wachter C, Hennig T, Bauer T et al.. Integrated optics towards third dimension. Proc. SPIE, 1998, 3278 :102 ~ 111
- [3] Bachmann, Besse P A, Melchier H. General self-imaging properties in N × N multimode interference couplers including phase relations. Appl. Opt., 1994, 33(18) 3905 ~ 3911
- [4] Yanagisawa M, Hashimoto T, Elisawa F et al. A 2.5 Gb/s hybrid integrated multiwavelength light source composed of eight DFB-LD's and an MMI coupler on a silica PLC platform. ECOC '98, Madrid Spain. 1998.77 ~ 78
- [5] Kin G , Kang B , Lee S et al. A multimode-interferenced electrooptic TE/TM mode splitter. CLEO Pacific Rim. 1999. 585 ~ 586
- [6] Augustsson T. Bragg grating-assisted MMI-coupler for add-drop multiplexing. J. Lightwave Technol., 1998, 16(8):1517 ~ 1522
- [7] Kudo K, Yashiki K, Sasaki T et al. 1.55 µm wavelengthselectable microarray DFB-LD's with monolithically integrated with MMI combiner, SOA, and EA-modulator. *IEEE Photon*. *Technol. Lett.*, 2000, 12(3) 242 ~ 243
- [8] Kriezis E E, Papagiannakis A G. A three-dimensional full vectorial beam propagation method for z-dependent structures. *IEEE J. Quant. Electron.*, 1997, QE-33(5) 883~890
- [9] Marcatilli E A J. Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics. *Bell Syst. Tech.*, 1969, 48 2071 ~ 2102
- [10] Huang J Z, Hu M H, Fujita J et al.. High-performance metal-clad multimode interference devices for low-indexcontrast material systems. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 1998, 10(4) 561 ~ 563

Self-Imaging Effect Analysis of MMI Devices with Two-Dimensional Confinement

Ma Huilian Jiang Xiaoqing Wang Minghua (Department of Information Science and Electronic Engineering , Zhejiang University , Hangzhou 310027) (Received 22 June 2001 ; revised 7 September 2001)

Abstract: The guided-mode propagation analysis method is used to analyze self-imaging effect of multimode interference (MMI) devices with two-dimensional confinement. And the three-dimensional full vectorial beam propagation method (BPM) is used to confirm the analytical results. The analysis indicates that the self-imaging effect can be widened to the two-dimensional confinement on the basis of the onedimensional confinement.

Key words: two-dimensional confinement ; multi-mode interference ; self-imaging effect ; guide-mode propagation analysis method ; three-dimensional full vectorial beam propagation method